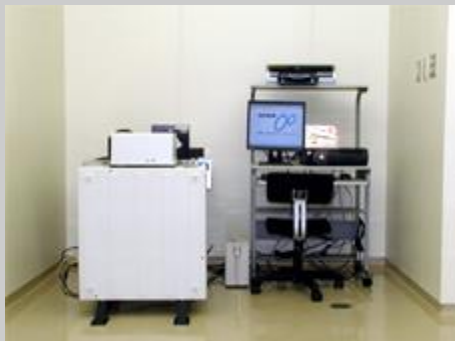


レーザー斜入射干渉方式 平面度測定解析装置



レーザー斜入射干渉方式
平面度測定解析装置
Corning Tropel
FM200XR-Heavy

平成15年度導入 (財) J K A 補助事業



【主な用途・仕様】

製品や部品などの平面度を迅速に測定する。斜入射レーザー光を用いることにより測定面が鏡面から鏡面でないものまで広範囲に測定できる。

- ・測定方式 プリズム式斜入射干渉
- ・光源 半導体レーザー (630nm)
- ・測定可能範囲 直径 25mm~200mm
- ・測定可能表面粗さ Ra4 μm 以下
- ・分解能 (Z方向) 0.01 μm
- ・測定精度 0.1 μm

【担当部署】 精密機械金属技術部：機械グループ

【設備使用の項目・使用料】 平面度測定解析装置

【受託試験の項目・手数料】 精密測定試験 (中級)

【お知らせ】 この装置は、山形県高度技術研究開発センターの設備です